

# DIN 32567-2:2014-10 (D)

## Fertigungsmittel für Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflüssen auf die optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 2: Prüfkörper für taktile Verfahren

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Anforderungen an die Prüfkörper.....	5
4.1 Allgemeines .....	5
4.2 Anforderungen an die Abmessungen der Schicht .....	5
4.2.1 Mindestschichtdicke, -länge und -breite.....	5
4.3 Anforderungen an Ebenheit, Welligkeit und Rauheit von Schicht und Substrat .....	7
4.3.1 Allgemeines .....	7
4.3.2 Konstanz der Schichtdicke .....	7
4.3.3 Ebenheit des Substrates .....	7
4.3.4 Welligkeit des Substrates .....	8
4.3.5 Rauheit des Substrates.....	8
5 Prüfkörper für topografische Schichtdickenmessungen.....	8
5.1 Allgemeines .....	8
5.2 Messverfahren .....	9
5.3 Prüfkörper A.....	10
5.3.1 Allgemeines .....	10
5.3.2 Schichtsysteme der Testobjekte .....	10
5.3.3 Referenzobjekte.....	12
Literaturhinweise.....	13